文章编号: 0258-7025(2002)Supplement-0439-05

缩苯胺类化合物的光存储性能研究*

陆子凤1 王广安1 刘益春1,2**

1东北师范大学理论物理研究所,长春 130024

2 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所激发态物理重点实验室,长春 130021/

提要 在可见光区域,在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中掺杂邻羟基亚甲基苯胺 (SA)样品中实现了可擦除光存储。 以 He-Ne 激光 632.8 nm 线为读出光,以 Ar^{*} 激光 488.0 nm 线为写入光和擦除光,研究了光栅写入和擦除的动力 学过程。在光栅的写人过程,观察到衍射信号强度随时间先增强后减弱的现象;在写人过程衍射信号强度增长阶 段开始擦除,亦可观察到此现象。而在写人过程衍射信号强度减弱阶段开始擦除,则观察到衍射信号直接变弱的 现象。依据相干光调制形成相位光栅和光异构产生压力梯度引起分子扩散的光物理过程对光存储机制进行了 探讨。

关键词 邻羟基亚甲基苯胺(SA),光异构,相位光栅,表面光栅 中图分类号 TQ597.3 文献标识码 A

Study on the Properties of Holographic Storage for the Thin Film of PMMA Doped with N-salicylideneaniline

LU Zi-feng¹ WANG Gang-an¹ LIU Yi-chun^{1,2}

¹ Institute of Theoretical Physics, Northeast Normal University, Changchun 130024 ² Key Laboratory of Excitation State Processes, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, The Chinese Academy of Sciences, Changchun 130021

Abstract It was realized that the erasable holographic storage in the visible range for the thin layers of PMMA matrices doped with N-salicylideneaniline material. An argon laser beam of 488.0 nm and a He-Ne laser beam of 632.8 nm were used as writing and reading light, respectively. The intensity of the diffraction signal increased with the increase of writing time, then it decreased with the increase of writing time. In the grating growing and dropping process, the relation between erasing time and grating diffraction signal was studied. For the former, the diffraction signal increased firstly, then decreased with the increase of the erasing time; for the latter, a decrease in the intensity of the diffraction signal was observed. A possible explanation is that pressure-driven mass transport induced from photo-isomerization which causes a change on the surface to form a surface-relief grating. However the surface-relief grating partly counteracts the phase-grating because of the two gratings with a phase difference of π .

Key words N-salicylideneaniline, optical isomerization, holographic grating, surface-relief grating

1 引 言

计算机工业的飞速发展与广泛应用,为光盘存储技术提供了美好的应用前景。目前,光盘存储技术由于一系列突出的优点,在声像、计算机、电子出版等方面得到了广泛的应用,已成为光电子产业的

- * 吉林省科技厅应用基础资助课题。
- *通信联系人。

主要支柱^[1]。可录光盘(CD-R)因允许用户自行记 录文字、声音、图像等信息,是近年来开发出的较成 功的光盘存储产品,现已投入大规模的生产与应用, 商业利润巨大。在光盘存储技术的发展过程中,开 发性能优异的存储材料一直是问题的关键和核心。 有机染料作为光盘存储介质的应用正受到越来越多 的重视,尤其是在可擦除型光盘的开发与应用中。

本文着重研究了 N-邻羟基亚甲基苯胺(SA) 在 可见光区的光存储性能。SA 是典型的水杨醛缩苯 胺类化合物,具有光致异构特性。常温状态下,SA 分子基态为稳定的烯醇构型,在紫外光照射下,SA 分子内的质子受激迁移形成较不稳定的酮构型。当 用可见光照射或加热时,可实现由酮构型到烯醇构 型的转化^[2]。本文利用 SA 的光异构特性,在可见 光区实现了可擦除光存储,并研究了光栅写入和擦 除的动力学过程。

2 实 验

本实验所用的 SA 为淡黄色粉末,由东京化成 工司生产。选用分析纯的三氯甲烷作溶剂,因为三 氯甲烷对选用的 SA 和 PMMA 有良好的溶解性,具 有适当的粘度和挥发性。将一定量的 SA 和 PMMA 分别溶于三氯甲烷有机溶剂中,按所需浓度以一定 比例混合搅拌,静置几个小时,待溶液无气泡后,均 匀旋涂于载波片上,将载波片密封于蒸发皿中,在干 燥箱中放十个小时后即获得具有所需浓度的光学薄 膜。本实验所用样品的浓度为 3.5wt.%,厚度约为 30 μm。



- 图 1 样品的吸收谱,无紫外光辐照(□)和被紫外光辐照 10 分钟(×)。插图表示吸收谱的放大图,波长在 410 nm 到 550 nm 范围变化,无紫外光辐照(a),被紫外光辐 照 10 分钟(b)
- Fig. 1 Absorption spectra of the SA thin film. (□) without UV-light irradiation, (×) irradiated with UV light for ten minutes. The inset shows the enlarged view of the absorption spectra in the range of 410 to 550 nm.
 (a) without UV light irradiation ; (b) irradiated with

UV - light for ten minutes

图 1 是样品的可见-紫外吸收光谱,用岛津公司 生产的 UV-360 型光谱仪测量。其中方框线由常温 条件下获得,十字花线是经 365.0 nm 紫外光辐照 十分钟后获得;插图是 410~550 nm 波段该吸收谱 的放大图,a、b 线分别是常温和经紫外光辐照十分 钟后获得的吸收谱。光存储实验在室温条件下进行,写入光和擦除光均为波长 488.0 nm 的 Ar⁺激光,读出光为波长 632.8 nm 的 He-Ne 激光。

实验装置如图 2 所示,光束 1 为读出光,两束写 入光束 2 与 3 之间的夹角为 10°,两束写入光和读出 光光斑大小相同,汇聚于样品的同一点上,衍射信号 由 CCD 接收并进入微机进行数据采集分析。



图 2 光存储实验装置图. M₁ ~ M₅ 为反射镜, B 为半反半透镜



3 结果和讨论

光

实验获得的光栅生长曲线如图 3 所示,横轴代 表写入时间,纵轴代表一级衍射信号的强度。



- 图 3 衍射信号强度与写入时间的变化关系。功率为 0.5 mW的 He-Ne 激光作读出光, Ar⁺ 激光作写入光, 写入 光功率是 4.0 mW
- Fig. 3 Intensity of the diffraction signal as a function of writing time with writing powers of 4 . 0 mW . The power of the He-Ne laser used for the readout is 0.5 mW

其实验条件为:写入光是波长为 488.0 nm 的 Ar⁺激光,功率是 4.0 mW;读出光是 632.8 nm 的 He-Ne 激光,功率为 0.5 mW。由图可见,一级衍射 信号的强度随写入时间的增加,呈现先增强后减弱 的趋势。其机理可作如下分析:首先从 SA/PMMA 样品的吸收谱可见,经 365.0 nm 紫外光辐照十分

钟后,SA样品的吸收谱发生红移,对488.0 nm光的 吸收增强。这说明该材料发生了光异构,SA分子由 烯醇构型转化成酮构型。尽管酮构型 SA 分子不稳 定^[3],但在室温条件下,由于热效应,SA分子的烯醇 构型会被热激发到酮构型^[4],因而在 SA/PMMA 样 品中,存在一定量的酮构型分子。当两束强度相同 的平行线偏振光作为写入光照射到样品上,会在样 品的表面形成明暗相间的干涉条纹。处于条纹亮区 酮构型的 SA 分子吸收 2.54 eV 的能量,会发生有 效的光异构过程转变成烯醇构型。由于 SA 分子是 对光偏振敏感的材料^[2],一部分酮构型的 SA 分子 吸收能量后,其主轴将按偏振光电矢量方向排列,形 成分子取向相位光栅^[5.6]。另一方面,由于 SA 分子 的两种构型自由体积不同,光异构使 SA 分子产生 自由体积变化,并因此而产生了光致异构压力,沿某 一方向 x 的压力可表示为

 $P_r =$

 $|B(FV_{\text{end}} - FV_{\text{keo}}/FV_{\text{keo}}) \cdot I_0 \cdot n_0 + P_{\sigma}|I_x A_x n_0$ (1)

其中 B 是常数,可由实验条件确定, FV_{end} 和 FV_{keto} 分别是烯醇和酮构型 SA 分子的自由体积, P_o 是因 表面张力σ形成的恢复力, n₀ 是在单位功率圆偏振 光辐照下醇构型分子的浓度, A_x 是归一化偏振系 数^[7,8]。

因为光照区光强呈高斯形分布,根据(1)式,可 知在光强最大的亮条纹中心, P. 最大;在光强小的 暗条纹区, P. 很小, 理想状态下, 可认为是零。P. 的 这种不均匀分布导致沿 x 方向产生了力的梯度 f(x)[如图4所示, I(x)表示光强, E(x)表示光场, f(x) 表示力的梯度, 箭头表示力梯度的方向, dE(x)/dx 表示沿x 方向光场的梯度, S(x) 表示表 面光栅]由图4可见,在亮条纹中心,光场梯度改变 了方向,力梯度的方向也随之改变,不难想象亮区的 SA分子在 f(x) 的作用下,将向两边扩散,最后堆积 在暗条纹处,形成了凸起;由于分子移出,亮区薄膜 表面就会形成凹陷。这种凸起凹陷的周期性分布就 形成了表面光栅。不难发现表面光栅与干涉场光强 分布具有位相差 π。而分子取向光栅与干涉场光强 分布同相,因此,表面光栅与分子取向相位光栅有位 相差 π^[9]。我们观察到的现象正是相位光栅和表面 光栅共同作用,效果相消的结果。这是因为表面光栅 的形成会影响相位光栅的增长,两者均按正弦分布, 周期相同,且位相相差π,故彼此相消^[9-11]。在光栅 生长的初始阶段,相位光栅占主导地位,增长快于表 面光栅,结果导致复合光栅逐渐增强,衍射信号逐渐 增强。随着写入时间的增加,光致异构过程使醇分子 浓度增大,扩散作用加强,表面光栅增强;又由于干 涉场亮区分子的取向逐渐趋于饱和,相位光栅增长 缓慢,因此复合光栅变化缓慢,衍射信号趋于饱和。 写入时间进一步增加时,表面光栅增长较快,并逐渐 占优势,而相位光栅趋于稳定,表面光栅逐渐抵消了 相位光栅,复合光栅逐渐减弱,因此衍射信号逐渐减 弱。



图 4 光场、光异构压力梯度以及光栅位相变化示意图 Fig. 4 The optical field, the gradience of force and the grating phase-shift analyses

为了能进一步理解 SA 材料的光存储特性,我 们还在写入过程衍射信号增强阶段进行了擦除实 验。其中写入过程条件为:写入光和读出光的功率 均为2.2 mW;擦除过程实验条件为:擦除光功率是 4.0 mW,读出光功率是 2.2 mW。图 5 是获得的实 验曲线,它表示在写入过程衍射信号强度增长阶段 开始擦除时,一级衍射信号强度随擦除时间呈先增 强后减弱的变化趋势。因为当用一束 Ar⁺ 激光进行 擦除时,光将均匀分布在样品的记录区,使记录区各 处光强相同。由光异构压力的表达式可见,在整个 记录区内光强相同,则异构压力相同,没有产生压力 梯度,不会发生质量输运过程。这就导致在整个擦 除过程中,表面光栅的增长受到了抑制,所以相位光 栅在擦除过程中起主导作用。而在写入过程衍射信 号强度增强阶段擦除时,相位光栅正处于增长阶段。 擦除光在记录区的均匀分布,使记录区的分子吸收 能量,主轴将按擦除光的偏振电矢量方向排列。由 于擦除光偏振方向与写入光的偏振方向相同,所以 原来记录亮区的分子取向被加强,而原来暗区的分 子也逐渐被擦除光调制发生取向,亮区分子取向的 效果会使两区折射率调制幅度增大,导致相位光栅 增强;而暗区分子取向的效果会使两区折射率调制 幅度减小,致使相位光栅变弱。而我们观察的现象 是相位光栅和表面光栅作用相消的结果。在擦除的 初始阶段,亮区分子取向增强占优势使相位光栅增 强,相位光栅和表面光栅作用形成的复合光栅增强, 衍射信号增强。随着擦除时间的增加,亮区分子取 向缓慢,亮暗区分子取向的结果使相位光栅不再增 长,复合光栅趋于稳定,衍射信号趋于饱和。当擦除 时间进一步增长时,暗区分子取向增长逐渐占优势, 而亮区分子取向趋于饱和,相位光栅减弱,复合光栅 减弱,此时衍射信号变弱。所以,我们能够观察到上 述实验现象。



- 图 5 衍射信号强度与擦除时间的变化关系。在写入过程衍 射信号强度增长时进行擦除,写入过程中,写入光和读 出光的功率均为 2.2 mW;擦除过程中,擦除光功率是 4.0 mW,读出光功率是 2.2 mW
- Fig. 5 Intensity of the diffraction signals versus the time with powers of erasing light 4.0 mW. The process carried out when the intensity of the signal grew strong during the writing process with the writing light of 2.2 mW. The power of the He-Ne laser used for the readout is 2.2 mW

此外,当写入过程的衍射信号强度已经减弱时, 关闭一束写入光,另一束光作为擦除光,我们还观察 到了光栅的一级衍射信号强度直接减弱的现象(如 图 6 所示)。对应的实验条件为:写入光和擦除光功 率均为 30.0 mW,读出光功率为 17.0 mW。从对写 人过程衍射信号强度随时间的变化关系可知,在写 人过程中衍射信号开始减弱时,相位光栅已经饱和, 并且强度大于表面光栅。而表面光栅增长变快,强 度逐渐增大,两者作用效果相消导致复合光栅减弱。 此时进行擦除,擦除光在原干涉场中的均匀分布抑 制了表面光栅的生长。同时由于相位光栅已经饱 和,原干涉场亮区分子取向已处于平衡状态,擦除光 仅使暗区的分子发生取相,结果导致明暗区折射率 变化幅度减小,相位光栅减弱。由于两光栅效果相 消,结果复合光栅依然减弱。因此,在这种实验条件下,我们仍可观察到衍射信号强度随擦除时间直接/ 减弱的现象。



- 图 6 衍射信号强度与擦除时间的变化关系。在写入过程衍 射信号强度减弱时进行擦除,写入过程中,写入光功率 为 30.0 mW,读出光功率是 17.0 mW;擦除过程中,擦 除光功率为 30.0 mW,读出光功率是 17.0 mW
- Fig. 6 Intensity of the diffraction signals versus the time with powers of erasing light 30.0 mW. The process carried out when the intensity of the signal grew weak during the writing process with the writing light of 30.0mW. The power of the He-Ne laser used for the readout is 17.0 mW

4 结 论

实验表明,邻羟基亚甲基苯胺(SA)在可见光区 具有可擦除光存储特性。本文依据光致异构产生异 构压力梯度形成分子扩散和相干光调制形成相位光 栅机制,对写入和擦除过程中光栅的一级衍射信号 随时间的变化关系进行了解释,提出上述现象是相 位光栅和表面光栅作用相消的结果。在写入过程的 初始阶段,分子取向相位光栅增长速度快于表面光 栅增长,两者相消的结果是复合光栅不断增强;随着 时间的增长,分子取向相位光栅生长缓慢或已近饱 和,而表面光栅增长速度变快,两光栅相消的结果导 致复合光栅逐渐变弱。所以在写入过程,一级衍射 信号强度随时间先增强后减弱。在写入过程衍射信 号增强阶段开始擦除,由于擦除光对表面光栅的抑 制作用,表面光栅不再增长,而原干涉条纹亮区的光 异构过程尚未达到动态平衡,所以擦除光会同时使 干涉场内亮暗区的 SA 分子取向,导致两区折射率 变化幅度先增大后变小,相位光栅先增强后减弱。 在此阶段,两光栅相消的结果会导致复合光栅先增 强后减弱,因而我们可以观察到衍射信号强度先增 强后减弱的现象。在写入过程衍射信号强度减弱时 开始擦除,由于写入光功率一定的情况下,发生光异 构的分子数是一定的,因而取向的分子数是一定的, 此时原干涉区亮条纹内分子不再变化,而暗条纹区 分子却不断取向,结果导致亮暗区折射率变化幅度 减小,相位光栅减弱。相位光栅和受抑制的表面光 栅相消的结果导致复合光栅也减弱,所以我们可以 观察到衍射信号直接减弱的现象。

参考文献

- 干福熹 主编. 数字光盘存储技术. 北京:科学出版社, 1998
- 2 M. Y. Shen, L. Z. Zhao, T. Goto *et al.*. Polarization dependence of photochromism in an N-salicylideneaniline single crystal. J. Chemical Physics, 2000, 5(112):1~8
- 3 B. Y. R. Destro, A. Gavezzotti, M. Simonetta. Salicylideneaniline. Acta Cryst., 1978, B34:2867~2869
- 4 Taro Sekikawa, Takayoshi Kobayashi, Tamotsu Inabe. Femtosecond fluorescence study of the substitution effect on the proton transfer in thermochromic Salicylideneaniline crystals. J. Phys. Chem. A, 1997, 101:644~649
- 5 Liu Yichun, Wang Haiyu, Tian Mingzhen *et al*... Multiple-hologram storage for thin layers of Methyl Orange

dyes in polyvinyl alcohol matrices. Opt. Lett., 1995, 20 $(13):1\sim3$

- 6 J. J. A. Couture, R. A. Lessard. Modulation transfer function measurements for thin layers of azo dyes in PVA matrix used as an optical recording material. *Appl. Opt.*, 1988, 27(16):3368~3374
- 7 C. J. Barrett, P. L. Rochon, A. L. Natansohn. Model of laser-driven mass transport in thin films of dyefunctionalized polymers. J. Chemical Phys., 1998, 109 (4):1505~1516
- 8 C. J. Barrett, A. Natansohn, P. L. Rochon. Mechanism of optically inscribed high – efficiency diffraction gratings in azo polymer films. J. Phys. Chem., 1996, 100:8836 ~8842
- 9 X. L. Jiang, L. Li, J. Kumar et al.. Polarization dependent recordings of surface relief gratings on azobenzene containing polymer films. Appl. Phys. Lett., 1996, 68(19):2618~2620
- 10 P. Rochon, E. Batalla, A. Natansohn. Optically induced surface graings on azoaromatic polymer films. *Appl. Phys. Lett.*, 1995, 66(2):136~138
- 11 N. C. R. Holme, L. Nikolova, P. S. Ramanujam et al.. An analysis of the anisotropic and topographic gratings in a side-chain liquid crystalline azobenzene polyester. *Appl. Phys. Lett.*, 1997, **70**(12):1518~1520